## 科学研究費助成事業

## 研究成果報告書



平成 26 年 6月 25 日現在

機関番号: 81406 研究種目:基盤研究(C) 研究期間:2011~2013 課題番号: 23560430 研究課題名(和文)光変調式誘電体散乱電界センサの開発

研究課題名(英文)Development of electric field sensor with optically modulated scatterer

研究代表者

黒澤 孝裕 (KUROSAWA, Takahiro)

秋田県産業技術センター・その他部局等・主任研究員

研究者番号:60370243

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 4,000,000円、(間接経費) 1,200,000円

研究成果の概要(和文):高周波電界中に半導体を設置して散乱体とし,そのバンドギャップエネルギーよりも大きな エネルギーを持つ光を照射すると散乱効率を変化させることができる.この特性を利用して散乱波に振幅変調を与え, 遠方で受信した散乱波強度に基づいて電界強度を測定する電界センサを提案した.アンドープゲルマニウム基板を散乱 体に用いて性能を評価した結果,従来の誘電体散乱電界センサの利点を保ったまま,10倍以上高速な時間応答性を得た .また,マイクロ波帯において金属エレメントを付加した光電界センサと同等の感度を達成した.これに加え,電界の 方向,振幅,位相が計測可能なこと,及び,感度と空間分解能を連続的に変化可能なことを示した.

研究成果の概要(英文): Electric field measurement sensor based on the modulated scattering technique wit h optically modulated scatterer had developed. A semiconductor is used as the scatterer, and illumination of the semiconductor with photons of energy larger than the band-gap energy of the scatterer, the scattering cross section can modulate. Undoped germanium is used as the optically modulated scatterer, time response of the detection is ten times faster than the previously developed dielectric scatterer system. This sensor obtained almost the same sensitivity of opt ical electric field sensor with metallic dipole elements in microwave region. This sensor can measure the direction, amplitude, and phase of electric field and can change the spatial resolution with varying the d iameter of illuminated light.

研究分野: 電気電子工学

科研費の分科・細目:電子デバイス.電子機器

キーワード:電界計測 変調散乱 光変調 誘電体 高周波 電磁環境両立性

1.研究開始当初の背景

携帯電話や GPS 等,マイクロ波を利用し ている無線通信システムが普及している.特 に自動車関連では,これらマイクロ波帯を利 用するシステムに加え,AM,FM,およびテ レビ放送波の受信も要求されており,中波か らマイクロ波帯までの非常に広い周波数帯を 無線通信に利用している.一方,今後普及が 見込まれる電気自動車やハイブリッド車には 動力用の大電力インバータが搭載されており, これから放射される不要電磁波ノイズが無線 通信システムに障害を起こす懸念がある.こ の電磁波ノイズを抑制するためには,電磁波 源近傍から比較的遠方までの3次元電磁界分 布を計測し,その発生源を特定することが有 用であると考えられる.

これまで,3次元電磁界分布を計測する手法として種々のものが提案されている.例えば,微小コイル等の磁界プローブや微小ダイポールアンテナ,光電界センサ,変調散乱素子等の電界プロープを使用して,空間を掃引することで電磁界を測定する手法が用いられてきた.しかしながら,金属製の信号伝達ケーブルやセンサ自体の金属部分によって測定対象の電磁界が乱れるため,被測定物近傍の電磁界強度を正確に測定することが困難であった.

このような電磁界の乱れを低減するため, 非金属製の光ファイバを信号伝達に使用する 光電界センサが提案されており,センサ本体 の非金属化および2次元像の一括測定が達成 されている.しかしながらこの手法で得られ る感度は数 V/m 程度であり,電磁波ノイズの 波源検出用途に応用するには感度が低い.高 感度を意図して金属エレメントを付加した光 電界センサも提案されているが,金属体によ る被測定電磁界の乱れが懸念される.

研究代表者らが提案してきた,誘電体散乱 を利用する高周波電界センサは,こういった 従来の電磁界測定技術の問題点を解決するも のであり,電子機器の放射電磁ノイズを正確 に評価することを可能とした.測定原理の概 略を以下に述べる.電磁波源が作る電磁界中 に誘電体を設置すると分極によって散乱波を 放射する.誘電体を機械振動あるいは空間 放射する.この散乱波を遠方に設置 したアンテナで受信し,復調することによっ て散乱波強度を検出する.この散乱波強度 したアンテナで受信し,復調することによっ て散乱波強度を検出する.この散乱波強度 可能なセンサ,すなわち完全非金属かつワイ ヤレスな高周波電界センサを実現した.

一方で,これらの機械的に散乱波を変調す る手法の場合,機械系の応答速度によって, 変調周波数は数十 Hz に制限される.このた め,信号対ノイズ比が十分な条件でも測定系 全体の時定数を小さくすることができず,短 時間で変動する信号の検出は困難であった. 2.研究の目的

このような背景をもとに,本研究では,高周

波電界中に設置した誘電体散乱体の誘電率を 光変調することによって散乱波を振幅変調し, この散乱体からの散乱波をアンテナで受信し, 復調することによって散乱体位置の電界を計 測する手法の確立を目指した.

誘電体散乱を利用した電界計測手法は研究 代表者らによるものが唯一であり,これまで は散乱体を機械振動あるいは回転させること により散乱波に振幅変調を与えていた.この 変調手法を発展させ,散乱体の誘電率自体を 変化させて散乱波を振幅変調することで電界 計測する手法は実証例が無い.これにより, 従来の誘電体散乱を利用した電界センサから 機械系による変調周波数の制限を除くことが でき,変調周波数も大きくできることから, より高速な測定が可能となる.

3.研究の方法

本研究では,高周波電界中に設置した誘電 体散乱体の複素誘電率を光変調することによ って散乱体からの散乱波に振幅変調を与え, その変調散乱波を遠方に設置したアンテナで 受信して復調して散乱波強度を検出する.検 出された散乱波強度に基づいて,散乱体位置 の電界を測定する.

測定系の模式図を図1に示す.既知の電磁 波源が作る電磁界中に誘電体散乱体を設置す る.この散乱体にある周波数で強度変調した 光を入射し,散乱体の誘電率を周期的に変化 させる.誘電率の周期的変化によって振幅変 調された散乱波を遠方に設置したアンテナで 受信し,直交検波器で復調してその電界強度 を測定する.同相,直交それぞれの検波器出



カについて,散乱体入射光の強度変化に同期 した強度変化を測定することで,振幅変調さ れた散乱波の強度および位相を得る.

散乱体材料には半導体を用いた.半導体に そのバンドギャップより大きなフォトンエネ ルギーの光を入射すると電子が伝導体に励起 されて導電率が増加する.この導電率増加に 伴って誘電損失が増大するため,散乱効率を 変化させることができる.半導体は誘電率の 実部が異なる様々な材料があり,ドーピング によって誘電損失も制御可能なため,広範囲 の物性選択肢が得られる.入射光源には半導 体レーザー(波長 638nm)を用い,周波数約 1kHzの矩形波で強度変調した.

電磁波源として近傍界波源にマイクロスト リップラインを,遠方界波源にアンテナを使 用し,感度,空間分解能などを評価した.

4.研究成果

(1). 近傍界電磁波源を用いた電界センサの性能評価

主に近傍電磁界を生成する波源として整合 終端したマイクロストリップライン(MSL)を 用い,2GHzの高周波信号を給電した.MSL の線幅は3mmとした.MSLへの給電電力を 変化させて散乱波強度を測定した結果を図2 に示す.散乱体にはアンドープゲルマニウム の単結晶基板(円板形状,直径25mm,厚さ 0.5mm)を用いた.照射光出力は5mWまたは 80mWとし,散乱波強度が最大となるように 照射位置を設定した.受信アンテナの偏波方 向はMSLの幅方向とした.比較のため,給 電電力の平方根に比例する値も実線で併せて 示した.





図から,散乱波強度は給電電力の平方根に ほぼ比例することが分かる.給電電力が減少 すると散乱波強度も減少し,測定系のシステ ムノイズレベルに収束する.また,照射光出 力が大きい場合,散乱波強度が大きくなる. これらの結果から,近傍界測定の場合,2GHz で-40dBm 程度の通過電力を検出可能といえ る MSL 近傍の電界強度は給電電力の平方根 に比例するため,観測された散乱波強度は電 界強度に比例すると考えられる.

光照射位置を MSL 幅方向に掃引し, 散乱 波強度を測定した結果を図3に示す. 受信偏 波方向を MSL の幅方向とした場合, 散乱波 強度はライン中央で極小値をとり, ライン両 端に向かって増加して極大値をとる. ライン



図3. 散乱波強度の光照射位置依存性. マイクロストリップライン(MSL)の上部 導体位置,および,受信アンテナの偏波 方向*E<sub>RX</sub>*とMSL設置方向との関係を併せ て示した.

端部よりさらに外側では減少して0に近づく. 一方,受信偏波方向をMSL 長手方向とした 場合,散乱波強度は小さくなる.これらの特 徴はMSL 近傍の面内電界強度分布に対応し ており,今回提案する手法によって近傍電磁 波源周辺の高周波電界分布を計測可能なこと が分かる.また,散乱波を受信するアンテナ の偏波方向によって計測する電界の方向成分 を選択可能とした.

散乱体照射光の直径を変え MSL 近傍の散 乱波強度分布を計測した結果を図 4 に示す. それぞれの測定結果は最大値が1 になるよう に規格化した.図から,照射光径が小さくな るに従い,極大をとる位置が内側に移動する とともに極大より外側の減少傾向が急峻にな ることが分かる.このことは,照射光径が小 さくなるに従って空間分解能が向上するため と考えられる.すなわち,散乱体照射光の直 続的に変化可能なことが示唆される.



図4. 散乱波強度分布の照射光径 Ø 依存性.

電磁波源として開放終端したMSLを用い, MSL の設置位置を掃引して散乱波強度およ び位相の2次元分布を計測した結果を図5に 示す.MSL 上に生じる定在波の腹,節に対応 した散乱波強度分布が観測された.また, MSL 幅方向に対して位相が反転すること,お よび,定在波の節を境に位相が反転すること,お よび,定在波の節を境に位相が反転すること が分かる.これらの特徴は開放終端線路の近 傍電界にみられる特徴と一致しており,MSL 近傍の電界強度および位相が正確に計測可能





図5. マイクロストリップライン近傍で観測 された散乱波振幅および位相の2次元像. マイクロストリップラインの位置を破線で 示した.

(2). 遠方界電磁波源を用いた電界センサの 性能評価

電磁波源として対数周期ダイポールアレイ アンテナを用い,その遠方界中に散乱体を設 置した.散乱体には,近傍界計測と同様のア ンドープゲルマニウム基板を用いた.照射光 の出力は80mWとした.

散乱体位置の電界強度を変化させて散乱波



図6. 散乱波強度の電界強度依存性.

強度を測定した結果を図6に示す.散乱波強度は散乱体位置の電界強度に比例することが分かる.電界強度が減少すると散乱波強度も減少し,ノイズレベルに収束する.

感度と復調時定数との関係を明らかにする ため、散乱波強度の信号対雑音比(SN比)の復 調時定数依存性を測定した.散乱体への印加 電界強度を 80dB µ V/m とした場合の結果を 図 7 に示す.SN 比は復調時定数の平方根に 比例することがわかる.印加電界強度を変化



図7. 散乱波強度の信号対雑音比(SNR)の 復調時定数**r**依存性. させて同様の測定をしたところ,散乱波強度 は電界強度に比例する一方,ノイズレベルは 電界強度に依存しなかった.これらのことか ら,SN 比は印加電界強度に比例して大きく なるとともに,復調時定数の平方根に比例し て大きくなると考えられる.

この結果から、復調時定数 1s において SN 比が 0dB となる電界強度を求めると、 1.05GHz で 65dB  $\mu$  V/m, 3GHz で 50dB  $\mu$ V/m となる.また、復調時定数 3ms での感 度は 1.05GHz で 90dB  $\mu$  V/m 3GHz で 75dB  $\mu$  V/m と見積もられる.この感度は、これま で報告されている微小ダイポールエレメント を付加した光電界センサの感度と同程度であ り、完全非金属構成のセンサで同等の感度を 達成した.また、従来の機械変調式誘電体散 乱電界センサと比較して 1/10 以下の小さな 時定数での計測が可能であり、短時間で変動 する高周波信号も計測できる.

散乱波強度の周波数依存性を図 8 に示す. 図から,照射光の直径 が大きくなるに従っ て高感度になることがわかる.また,1-7GHz の範囲で感度を持つこと,および,周波数が



図8. 散乱波強度の周波数依存性.

高くなるに従って高感度となる.このため, 今後,電子機器の高動作周波数化に対しても, 容易に対応可能なことが期待できる.

(3)まとめ

以上,近傍,遠方,両電磁波源を用いた評 価結果から,本研究によって,誘電体散乱体 の複素誘電率を光変調することによって散乱 体からの散乱波を振幅変調し,散乱波を遠方 で受信して復調することにより,高周波電界 を計測可能なセンサを構成できることが明ら かとなった.これにより,完全非金属構成の センサによって,高周波電界の方向,振幅 位相を計測可能な新たな手法を提案するとと もに,従来の機械変調式誘電体散乱電界セン サよりも 10 倍以上高速な変調周波数を達成 した.この結果,誘電体散乱電界センサの特 長を保ったまま、短時間で変動する信号の計 測を可能とした.また,散乱体照射光の直径 を変化させることにより,感度および空間分 解能を連続的に変化できることが明らかとな った.得られた感度は金属エレメントを付加 した光電界センサと同程度であり,本提案手 法によって、これより低擾乱な高周波電界計

## 測を可能とした.

これら本研究成果により,電子機器から生 じる不要電磁波ノイズの波源探知や伝搬経路 の特定の際に重要な情報となる電磁波源近傍 の電界分布を,従来よりも低擾乱かつ高速に 測定することが可能となる.また,位相情報 も計測できることから,プリント基板上に作 成した平面回路やアンテナ等の動作検証も可 能である.

5.主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計 3件)

- [1] <u>黒澤 孝裕</u>, 駒木根 隆士,"光学的変 調散乱素子を用いた高周波電界計測シ ステム,電子情報通信学会誌 B,査読有, Vol. J97-B, No.3, 2014, pp.279-285
- [2] T. Komakine, <u>T. Kurosawa</u>, and H. Inoue, "Electric Field Intensity of Cylindrical Dielectric Probe in Scattering Method for EM Field Measurement", 2012 Proceedings of SICE Annual Conference, 查読有, Vol. 12PR0001, 2012, pp.412-415.
- [3] <u>T. Kurosawa</u> and T. Komakine, "Electric Field Measurement by using Cylindrical Dielectric Scatterer", 2012 Proceedings of SICE Annual Conference,查読有, Vol. 12PR0001, 2012, pp.407-411.

〔学会発表〕(計 7件)

- [1] "マイクロストリップラインの近傍界を 利用した光学的変調散乱素子の空間分解 能評価",<u>黒澤 孝裕</u>, 電子情報通信学 会 2013 年ソサイエティ大会,2013.9.19, 福岡工業大学.
- [2] "光学的変調散乱素子を用いた電界セン サの GHz 帯における性能評価", <u>黒澤</u> <u>孝裕</u>, 駒木根 隆士,電子情報通信学会 2013 年総合大会, 2013.3.20,岐阜大学.
- [3] "光学的変調散乱素子を用いた高周波電 界の計測",<u>黒澤 孝裕</u>,駒木根 隆士, 電子情報通信学会 2012 年ソサイエティ 大会,2012.9.12,富山大学.
- [4] "Electric Field Intensity of Cylindrical Dielectric Probe in Scattering Method for EM Field Measurement", T. Komakine, <u>T. Kurosawa</u>, and H. Inoue, 2012 SICE Annual Conference, 2012.8.21, Akita University.
- [5] "Electric Field Measurement by using Cylindrical Dielectric Scatterer", <u>T.</u> <u>Kurosawa</u> and T. Komakine, 2012 SICE Annual Conference, 2012.8.21, Akita University.
- [6] "電界分布計測による放射ノイズ源の可 視化およびノイズ対策事例",<u>黒澤 孝</u>

<u>裕</u>,駒木根 隆士,電子情報通信学会 2012 年総合大会,2012.3.23,岡山大学.

 [7] "変調散乱手法による電界計測における 干渉波を用いる変調法",駒木根 隆士,
<u>黒澤 孝裕</u>,宮永 和明,井上 浩,電 子情報通信学会 2011 年ソサイエティ大 会,2011.9.13,北海道大学.

〔図書〕(計 0件)

〔産業財産権〕 出願状況(計 0件) なし

取得状況(計 1件) [1] 名称:電磁界計測システム 発明者:黒澤 孝裕 権利者: 種類:特許 番号:特許第4915565号 取得年月日:2012年2月3日 国内外の別;国内

〔その他〕 ホームページ等

6.研究組織 (1)研究代表者 黒澤 孝裕 (KUROSAWA, Takahiro) 秋田県産業技術センター 主任研究員 研究者番号:60370243

(2)研究分担者 なし

(3)連携研究者 なし